



제 30회 한국반도체학술대회

The 30th Korean Conference on Semiconductors

2023년 2월 13일(월)~ 15일(수) | 강원도 하이원리조트(그랜드호텔 컨벤션타워)

2023년 2월 14일(화), 09:00-10:30

Room J (하트 III, 6층)

Q. Metrology, Inspection, Analysis, and Yield Enhancement 분과

[TJ1-Q] Metrology, Inspection, Analysis, and Yield Enhancement I

좌장: 강상우 소장 (한국표준과학연구원), 정용우 TL(SK 하이닉스)

TJ1-Q-1 09:00-09:30 [초청]	Mechanical Characterization of Silicon Structure for Nanoscale Device Using Experimental Techniques Jae-hyun Kim SK Hynix
TJ1-Q-2 09:30-10:00 [초청]	Co-enhancement of Sensitivity and Throughput of TSOM Using Adaptive Optics (AO) and Plenoptics Jun Ho Lee ¹ , Ji Yong Joo ¹ , Ji Won Park ¹ , Junhee Jeong ² , and Oh-hyung Kwon ² ¹ Kongju National University, ² Nextin, Inc.
TJ1-Q-3 10:00-10:30 [초청]	반도체 High Volume Manufacturing을 위한 검사/계측의 발전 방향 손영훈, 박장익 삼성전자 DS부문 메모리/MI기술팀